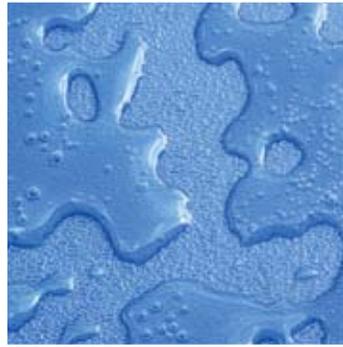
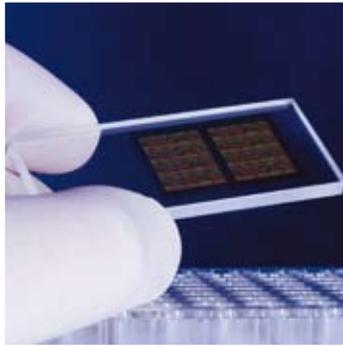


IoN 40 等离子体系统





IoN 40 等离子体系统

IoN 40是我们在真空等离子体技术领域的最新进展。气体等离子体依靠其多功能性、绿色环保，正在迅速成为生命科学、电子和工业领域中对材料表面进行改性的首选技术。例如，医疗诊断设备的微型化趋势要求精密清洁和选择性化学功能化的表面。等离子体去除有机污染的效果比湿化学法要高几个数量级，而且可以在纳米级别内使表面化学功能化。因此，等离子技术正在取代不再经济或不再实用的传统处理方法。

IoN 40旨在满足用户不断变化的需求，着重于表面处理需求的多功能性和可控性。其先进的性能提供了出色的工艺控制、失效保护报警系统和数据采集软件。这使系统可满足生命科学工业中严格的质量控制程序。IoN 40结构紧凑、集成度高，采用射频（RF）激发等离子体。它的台式设计使其很容易安装在实验室或生产环境中。

先进的功能性：

- 完全可配置的腔室可使用各种不同的电极构造，适用于中等尺寸的结构复杂的3维工件或大批量的小工件处理
- 使用Windows系统的工业计算机
- 符合CFR(美国联邦法规)第21章第11部分和Semi E95-1101的图形用户界面（GUI）
- 单独的用户软件访问权限：操作者、工艺编写、维护
- 自定义的工艺误差控制保证了精确的批次可重复性
- 通过以太网进行远程统计过程控制监测
- 机载诊断功能和报警记录
- 工艺编辑软件提供了快速灵活的步骤控制功能
- 液晶触摸屏显示器（LCD）和键盘

技术参数

工作腔室材料	铝
容积	38 升
内部尺寸	229 x 330 x 483 mm 9" x 13" x 19"

德国普发拓普公司北京代表处
北京市朝阳区光华路12A号格瑞大厦A座406室，100020
电话：+86-10-65814049/50
传真：+86-10-65814079
电邮：sales@pvatepla.com.cn
网址：www.pvatepla.com.cn
www.pvateplaamerica.com

可用电极

- 初级等离子体
 - 垂直电极
 - 侧壁电极
 - 可抽卸的3层或5层330 mm x 483 mm (11.38" x 13.15") 托盘
 - 3层温控电极
 - 低微粒电极
- 次级等离子体电极

工艺气体

质量流量控制计 最多至8路气体

工艺压力

大约 120-2000 mTorr
(取决于真空泵和气体流量)

抽真空时间

大约1分钟
(取决于真空泵)

放气

可调

射频发生器

风冷，100 KHz，300 瓦
(标准配置)

供给需求电源

110 V 或 220 V 单相
2.3 KW，50/60 Hz

工艺气体

输入压力 1- 2 bar
30 PSI

吹扫气体

输入压力 1- 2 bar
30 PSI

压缩空气

输入压力 5 bar
75 PSI

尺寸 宽/高/深

775 x 723 x 781 mm
30.5" x 28.5" x 30.75"

重量

156.36 千克 / 344 磅

可选项

- 1% 精度的压力测量
- 压力控制器
- 指示灯柱
- 条形码阅读器
- 工艺气体切换器
- 光谱终点检测器
- 300 瓦或 600 瓦 13.56 MHz射频发生器
- 不锈钢MFC
- 打印机
- 循环液体冷却器
- 桌子
- 单体处理装置
- 真空泵（旋片泵、干泵或涡轮泵）
- 气相MFC

安全认证标准

- 独立实验室测试
- CE 认证
 - EN 61010
 - EN 61326